### ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет радиотехники и электроники

"УТВЕРЖДАЮ"

Декан РЭФ

профессор, д.т.н. Хрусталев Владимир Александрович

### Проектирование микросистем

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ООП: специальность 210108.65 Микросистемная техника				
Шифр по учебному	Шифр по учебному плану: СД.Ф.8			
Факультет: радиоте	ехники и элег	ктроникиочная ф	форма обучения	
Курс: 5, семес	тр: 9			
Лекции: 34				
Практические работ	гы: 18	Лабораторные	е работы: 34	
Курсовой проект: -	Курс	овая работа: -	РГ3: -	
Самостоятельная ра	бота: 48			
Экзамен: 9	Зачет: -			

Новосибирск

2011

15547/14649

Всего: 150

Рабочая программа составлена на основании \_Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению (специальности): 210100 Электроника и микроэлектроника.(№ 737 тех/сп от 18.01.2006)

СД.Ф.8, дисциплины федерального компонента

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры Полупроводниковых приборов и микроэлектроники протокол № 4 от 24.05.2011

Программу разработал

профессор, д.т.н.

Гридчин Виктор Алексеевич

Заведующий кафедрой

д.ф.м.н.

Гайслер Владимир Анатольевич

Ответственный за основную образовательную программу

д.ф.м.н. Гайслер Владимир Анатольевич

### 1. Внешние требования

Таблица 1.1

Шифр дисциплины	Содержание учебной дисциплины	Часы
СД.06	Проектирование микросистем:	150
	математические модели элементной базы микросистемной техники; теория подобия и эффекты масштабирования; механические модели в электромеханике: механическое равновесие, уравнение баланса динамических величин, уравнение движения, термомеханические, статические и динамические модели мембран, балок, струн; физикотопологические модели базовых элементов поверхностной и объемной микромеханики; модели микросистем с электрическими и магнитными полями: полевые уравнения, краевые задачи, общие уравнения для электромагнитного и пьезоэлектрического преобразователя; модели течения жидкости и газа в микрообъемах и микрокапиллярах; имитационное динамическое моделирование микросистем; программные средства обеспечения САПР компонентов микросистемной техники; интеграция элементной базы микроэлектромеханики, микрооптики и микроэлектроники при проектировании микросистем.	

### 2. Особенности (принципы) построения дисциплины

Таблица 2.1

Особенности (принципы) построения дисциплины

	Сппости (припципы) постросния дисциплипы
Особенность	Содержание
(принцип)	
Основания для введения	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
дисциплины в учебный	ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
план по направлению или	направление подготовки 210100 - Электроника и
специальности	микроэлектроника, специальность 210108 - Микросистемная
	техника, квалификация - инженер.
Адресат курса	Специалисты по профилю специальности 210108 -
	"Микросистемная техника".
Основная цель (цели)	Формирование знаний по проектированию изделий
дисциплины	микросистемной техники.
Ядро дисциплины	Методы проектирования микросистем теплового потока,
	резонансных сенсоров давления, тензорезистивных сенсоров
	давления и важнейших компонент микросистемной техники.
Связи с другими учебными	Компоненты микросистемной техники.
дисциплинами основной	
образовательной	
программы	
Требования к	Необходимо знать информатику, дисциплины
первоначальному уровню	естественнонаучного цикла, теорию упругости, физические
подготовки обучающихся	принципы функционирования компонент микросистемной
	техники.
Особенности организации	Контроль знаний проводится в ходе проведения
учебного процесса по	практических и лабораторных работ, курсового проекта и
дисциплине	экзамена.
	Форма проведения экзамена - письменная.

### 3. Цели учебной дисциплины

Таблица 3.1

После изучения дисциплины студент будет

иметь	
представление	
1	Об основных принципах организации проектирования, необходимых
	документах и тенденциях развития микросистем.
знать	
2	методику проектирования микросистем на основе терморезисторов и
	термопар, сенсоров давления на основе тензорезистивного эффекта и
	резонансных сенсоров давления, акселерометров.
уметь	
3	Провести расчет всех элементов конструкции и электрической схемы
	перечисленных выше типов сенсоров.
иметь опыт	
(владеть)	
4	Проектирования микросистем как "вручную", так и с помощью САПР
	микросистем.

### 4. Содержание и структура учебной дисциплины

Лекционные занятия \_\_\_\_\_ Таблица 4.1

химинований жений	1 40311	1ца 4.1
(Модуль), дидактическая единица, тема	Часы	Ссылки на цели
Семестр: 9		
Модуль: Введение.		
Дидактическая единица: математические модели элементной базы		
микросистемной техники; теория подобия и эффекты		
масштабирования;		
Введение. Предмет и цели дисциплины. Понятие микросистемы.	2	1
Микросистемы и микроэлектроника. Тенденции развития. Примеры		
микросистем.		
Масштабирование и подобие. Критерии подобия. Подобие для	2	2
динамических процессов. Примеры.		
Модуль: Микросистемы тепловых величин.		
Дидактическая единица: механические модели в электромеханике:		
механическое равновесие, уравнение баланса динамических величин,		
уравнение движения, термомеханические, статические и динамические		
модели мембран, балок, струн;		
Проектирование термических микросистем. Общая структура	2	2, 3, 4
микросистемы. Проектирование тензочувствительного модуля.		
Проектирование термической микросистемы. Проектирование	2	2, 3
термопар. Шумы термопар. Чувствительность микросистемы.		
Микросистема сенсора теплового потока. Конструктивная реализация.	4	2, 3, 4
Электрическая схема. Измерение малых тепловых потоков с помощью		
микроболометра.		
Модуль: Микросистемы давления.		
Дидактическая единица: физико-топологические модели базовых		
элементов поверхностной и объемной микромеханики; модели		
микросистем с электрическими и магнитными полями: полевые		
уравнения, краевые задачи, общие уравнения для электромагнитного и		
пьезоэлектрического преобразователя;		

Динамические характеристики упругого элемента балочного типа. Добротность резонатора. Электростатическое возбуждение колебаний балочки резонатора. Основное уравнение. Частотный и фазовый анализ колебаний. Влияние предварительной деформации двусторонне защемленной балочки на ее резонансную частицу. Микросистема резонансного сенсора давления. Конструкция резонансного сенсора давления. Выбор параметров резонатора. Влияние технологических факторов на преобразовательную характеристику сенсора. Блок-схема электронной части резонансного сенсора.	8	2, 3, 4
Модуль: Микрофлюидные микросистемы.		
Дидактическая единица: модели течения жидкости и газа в		
микрообъемах и микрокапиллярах; имитационное динамическое моделирование микросистем;		
Проектирование элементов микрофлюидных систем. Основные	9	2, 3, 4
уравнения гидродинамики. Вязкость жидкости. Статическое и		
динамическое давление жидкости. Измерение давления в потоке. Типы		
течения жидкости. Ламинарное и турбулентное течение жидкости.		
Поверхностное натяжение. Критерии Рейнольдса, Эйлера, Вебера,		
Пекле, Кнудсена. Аналогия между микрофлюидными и		
электрическими величинами. Гидродинамическое сопротивление и		
закон Гагена-Пуазейля. Гидродинамическая емкость и индуктивность.		
Проектирование микромиксера. Практические схемы микромиксеров.		
Экстракторы. Микронасосы. Классификация и принципы действия		
микрофлюидных насосов. Проектирование микронасоса с		
электростатическим управлением.		
Модуль: Проектирование компонентов микросистем.		
Дидактическая единица: программные средства обеспечения САПР		
компонентов микросистемной техники; интеграция элементной базы		
микроэлектромеханики, микрооптики и микроэлектроники при		
проектировании микросистем.		
Пьезоэлектрические преобразователи. Микромеханические насосы с	4	2, 3
активными и пассивными клапанами. Актюаторные элементы		
микросистемной техники. Проектирование интегральных микрозеркал.		
САПР микросистем. Тенденции развития микросистем.	1	1

Практические занятия

Таблица 4.2

(Модуль), дидактическая единица, тема	Учебная деятельность	Часы	Ссылки на цели
Семестр: 9			
Модуль: Микросистемы давления.			
Дидактическая единица: механические модели в			
электромеханике: механическое равновесие,			
уравнение баланса динамических величин,			
уравнение движения, термомеханические,			
статические и динамические модели мембран,			
балок, струн;			
Упругий элемент в виде консольной балки	Решение задач	2	2, 3, 4
тензометрического сенсора силы (статическая	по теме занятия.		
нагрузка).			
Дидактическая единица: физико-топологические			
модели базовых элементов поверхностной и			

объемной микромеханики; модели микросистем с			
электрическими и магнитными полями: полевые			
уравнения, краевые задачи, общие уравнения для			
электромагнитного и пьезоэлектрического			
преобразователя;			
Электростатическое возбуждение резонаторов.	Решение задач	1	2, 3, 4
	по теме занятия.		
Магнитное возбуждение резонаторов.	Решение задач	1	2, 3, 4
	по теме занятия.		
Модуль: Микрофлюидные микросистемы.			
Дидактическая единица: модели течения жидкости			
и газа в микрообъемах и микрокапиллярах;			
имитационное динамическое моделирование			
микросистем;			
Проектирование микрофлюидных систем.	Решение задач	2	2, 3, 4
проектирование микрофлюндных епетем.	по теме занятия.		2, 3, 1
Модуль: Проектирование компонентов	по теме запитии.		
микросистем.			
Дидактическая единица: механические модели в			
электромеханике: механическое равновесие,			
уравнение баланса динамических величин,			
уравнение объящей динамических величин, уравнение движения, термомеханические,			
статические и динамические модели мембран,			
•			
балок, струн; Проектирование упругого элемента одноосного	Решение задач	2	2, 3, 4
акселерометра линейных ускорений.	по теме занятия.	2	2, 3, 4
Проектирование механических гироскопов.	Решение задач	2	2, 3, 4
просктирование механических гироскопов.		2	2, 3, 4
Продуживарация дарминарация сансовов баначиста и	по теме занятия.	2	2 2 1
Проектирование термических сенсоров балочного и	Решение задач	2	2, 3, 4
мембранного типов.	по теме занятия.		2 2 4
Проектирование тензорезистивных сенсоров	Решение задач	2	2, 3, 4
давления (статические нагрузки).	по теме занятия.	2	2 2 4
Проектирование резонансных сенсоров давления.	Решение задач	2	2, 3, 4
Динамические характеристики резонаторов.	по теме занятия.		
Дидактическая единица: физико-топологические			
модели базовых элементов поверхностной и			
объемной микромеханики; модели микросистем с			
электрическими и магнитными полями: полевые			
уравнения, краевые задачи, общие уравнения для			
электромагнитного и пьезоэлектрического			
преобразователя;			
Проектирование пьезоэлектрических актюаторов.	Решение задач	1	2, 3, 4
	по теме занятия.		
Проектирование микрозеркал.	Решение задач	1	2, 3, 4
	по теме занятия.	1	

Лабораторная работа

Таблица 4.3

(Модуль), дидактическая единица, тема	Учебная деятельность	Часы	Ссылки на цели
Семестр: 9			
Модуль: Проектирование компонентов			
микросистем.			

Дидактическая единица: программные средства обеспечения САПР компонентов микросистемной техники; интеграция элементной базы микроэлектромеханики, микрооптики и микроэлектроники при проектировании микросистем.			
Освоение пакета MEMS Pro.	Работа с пакетом программ MEMS Pro.	10	2, 3, 4
Освоение работы в системе S-Edit и системы T-Spice пакета MEMS Pro.	Работа с пакетом программ MEMS Pro.	8	2, 3, 4
Анализ работы емкостного акселерометра гребенчатого типа.	Работа с пакетом программ MEMS Pro.	8	2, 3, 4
Проектирование топологии гороскопа на основе гребенчатых элементов.	Работа с пакетом программ MEMS Pro.	8	2, 3, 4

### 5. Самостоятельная работа студентов

#### Семестр- 9, Контрольные работы

Решение задач и теоретический вопрос.

Подготовка по конспектам 18 часов.

#### Семестр- 9, Подготовка к занятиям

Работа с конспектом, решение задач. 30 часов.

6. Правила аттестации студентов по учебной дисциплине

№ п/п	Вид деятельности	Число баллов
1	Практические занятия	0 - 20
2	Лабораторные занятия	0 - 15
3	Курсовой проект	0 - 25
4	Экзамен	0 - 40
	Всего	не более 100 баллов

Удовлетворительная оценка ставится при числе баллов 60.

#### 7. Список литературы

#### 7.1 Основная литература

#### В печатном виде

- 1. Гридчин В. А. Физика микросистем. Ч. 2 : [учебное пособие для вузов] / В. А. Гридчин, И. Г. Неизвестный, В. Н. Шумский. Новосибирск, 2006. 495 с. : ил.
- 2. Варадан В. ВЧ МЭМС и их применение / В. Варадан, К. Виной, К. Джозе ; пер. с англ. под ред. Ю. А. Заболотной. М., 2004. 525 с. : ил., табл., цв. ил.

#### В электронном виде

1. Гридчин В. А. Физика микросистем. Ч. 2 : [учебное пособие для вузов] / В. А. Гридчин, И. Г. Неизвестный, В. Н. Шумский. - Новосибирск, 2006. - 495 с. : ил.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2006/gridchin.pdf

#### 7.2 Дополнительная литература

#### В печатном виде

1. Драгунов В. П. Наноструктуры: физика, технология, применение: учебное пособие / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2008. - 354, [1] с.: ил.

#### В электронном виде

1. Драгунов В. П. Наноструктуры: физика, технология, применение: учебное пособие / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2008. - 354, [1] с.: ил.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2008/dragunov.pdf. - Инновационная образовательная программа НГТУ "Высокие технологии".

#### 8. Методическое и программное обеспечение

#### 8.1 Методическое обеспечение

#### В печатном виде

1. Гридчин В. А. Физика микросистем. Ч. 1: Учебное пособие для вузов / В. А. Гридчин, В. П. Драгунов; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2004. - 415 с.: ил.

#### В электронном виде

1. Гридчин В. А. Физика микросистем. Ч. 1 : Учебное пособие для вузов / В. А. Гридчин, В. П. Драгунов; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2004. - 415 с. : ил.. - Режим доступа: http://www.ciu.nstu.ru/fulltext/textbooks/2004/04 gridchin.pdf

#### 8.2 Программное обеспечение

1. ANSYS Inc, ANSYS ACADEMIC Mechanical HPC, Программный комплекс для моделирования технологических процессов в микро- и наноэлектротехнике Ansys 11.0

# 9. Контролирующие материалы для аттестации студентов по дисциплине Примерный перечень вопросов

- 1. Критерии подобия. Подобие для динамических процессов.
- 2. Принцип действия термопар. Проектирование термопар.
- 3. Расчет температурного поля балочного элемента.
- 4. Проектирование сенсора потока излучения балочного типа.
- 5. Микросистема сенсора теплового потока на мембране.
- 6. Микроболометры. Принцип действия, конструкция.
- 7. Деформация консольно защемленной балки под действием сосредоточенной силы.
- 8. Деформация двусторонне защемленной балки под действием сосредоточенной силы.
- 9. Колебание консольной балочки под влиянием периодической внешней силы.
- 10. АЧХ и ФЧХ колеблющейся консольной балки.
- 11. Влияние технологических факторов на преобразовательную характеристику РСД.
- 12. Особенности проектирования микрофлюидных систем.
- 13. Критерии течения жидкости в микроканалах.
- 14. Гидродинамическое сопротивление. Закон Гагена-Пуазейля.
- 15. Проектирование микромиксеров.
- 16. Микронасосы. Принципы действия и классификация.
- 17. Проектирование микронасоса с электростатическим управлением.
- 18. Пьезоэлектрические микронасосы с активными и пассивными клапанами.
- 19. Проектирование микрозеркал.

### 20. Микросистема проекционного дисплея.

### Пример экзаменационного билета

Федеральное государственное	Форма У-16 Экзаменационный билет № 1
бюджетное образовательное	по дисциплине «Проектирование микросистем»  Факультет РЭФ Курс
учреждение высшего профессионального образования	
«Новосибирский государственный	
технический университет» (НГТУ)	
<ol> <li>Критерии подобия в мик</li> <li>Микронасосы. Принципи</li> <li>Проектирование микрозе</li> </ol>	ы действия и классификация.
Составил: д.т.н., профессор/тверждаю: Зав. кафедрой, проф	В. А. Гридчин рессор В. А. Гайслер